

北航微纳中心收费标准及依据

北京航空航天大学智能微纳公共创新中心是学校规划的一个重要的公共服务教学和科研平台。微纳中心主要依托最高至百级的超净间环境，提供微纳加工及测试服务，日常开销包括超净环境的动力、空调、水电等环境维持系统不间断运行费、微纳科研设备定期校准和维护费、超净服和无尘纸等相关支出。微纳中心由于需要自行负担运行维护成本，对于校内用户和校外用户进行收费使用，收费标准是综合考虑了各项支出费用，收费价格参考了清华微纳平台、北大量子微纳平台、物理所微加工实验室、苏州纳米所微纳平台等多所微纳平台而定。

具体收费原则如下：

1) 仪器开放使用类标准，根据设备的运行和管理要求，据实测算服务成本，并参照其他单位同类别设备标准收取机时费(或材料费)；送样检测服务类标准，参照其他单位同类别服务标准收取测试费；实验技术服务类标准，依据实际发生情况收取机时费、测试费的基础上，收取技术服务费。

2) 校内用户为收费标准的 6 折。

3) 自筹设备方使用其放入通用平台的设备可以选择 2 种方案。一是收费使用方案，收费是标准的 3 折；二是免费使用方案，每周免费使用一定天数，其他时间开放他人。

微纳公共平台收费标准							
设备名称	设备型号	设备类型	加工内容	收费标准	校内费用	培训费	备注
超净间				60 (元/时)	36 (元/时)	元/人次	代操作费为总价30%
光刻机	Microlab	图形化	曝光, 显影	800 (元/小时)	480 (元/小时)	800	
紫外光刻机	MA6-BA6	图形化	曝光, 显影	1200 (元/小时)	720 (元/小时)	1200	半小时为计量单位
激光直写系统	Microwriter ML Baby	图形化	曝光, 显影	600 (元/小时)	360 (元/小时)	600	
EBL (电子束曝光)		图形化	曝光, 显影	1500 (元/时)	900 (元/时)	1500	一小时为计量单位
纳米结构高速直写机	NanoFrazor Explore	图形化	曝光, 显影	1200 (元/时)	720 (元/时)	1200	
微结构曝光		图形化	曝光, 显影	600 (元/小时)	360 (元/小时)	600	
反应离子刻蚀系统 无LoadLock		刻蚀	刻蚀、去胶	600 (元/时)	360 (元/时)	1200	
反应离子刻蚀系统LoadLock		刻蚀	刻蚀、去胶	2000 (元/时)	1200 (元/时)	1200	
电感耦合等离子体刻蚀系统LoadLock	PlasmaPro System100/1 ICP180	刻蚀	刻蚀、去胶	2000 (元/时)	1200 (元/时)	1200	
电感耦合等离子体化学气相沉积系统 (ICP-CVD) LoadLock	PlasmaPro System100/1 HDPECVD 180	材料制备	SiN, SiO2等	1200 (元/时)	720 (元/时)	1200	
化学气相沉积 无LoadLock	PECVD-601	材料制备	SiN, SiO2等	600 (元/时)	360 (元/时)	800	
化学气相沉积LoadLock		材料制备	SiN, SiO2等	1000 (元/时)	600 (元/时)	1000	
电子束与电阻蒸发设备无LoadLock	DZS-500型	材料制备	Ti、Cr、Al等贵金属另计	600 (元/时)	360 (元/时)	1500	Au/Pt 40元/10nm
真空退火炉无LoadLock 8英寸	VTS-25A	材料制备	样品处理	800 (元/时)	480 (元/时)	800	
原子层沉积系统ALD		材料制备	Al, Ti等, Hf源另计	600 (元/时)	360 (元/时)	1000	HfO2: 25元/1nm
X射线反射衍射仪	Delta-X	表征	晶体结构	1200 (元/时)	720 (元/时)	1200	
物理学院教学用XRD		表征	晶体结构	1200 (元/时)	720 (元/时)	1200	
低温磁场探针台	MF-CRYOX80	表征	电学磁学测试	1200 (元/时)	720 (元/时)	1200	
AFM原子力显微镜	multimode 8	表征	形貌	600 (元/时)	360 (元/时)	600	
大视场光学显微镜	DXS500	表征	形貌	600 (元/时)	360 (元/时)	600	
拉曼系统	IHR550	表征	光学	600 (元/时)	360 (元/时)	600	
NanoMOKE磁光克尔系统	NanoMOKE 3	表征	磁学测试	600 (元/时)	360 (元/时)	600	
匀胶旋涂仪+热板	WS-650Mz-8NPPB	材料制备		包含在光刻机费用里	包含在光刻机费用里	300	半小时为计量单位, 光刻胶按m折算
湿法清洗台	SFQ-400系列清洗机	材料制备		600 (元/时)	360 (元/时)	300	化学品另计
氧等离子体去胶机	Q150	刻蚀		600 (元/时)	360 (元/时)	300	半小时为计量单位
紫外臭氧清洗机UVO	PSDP-UV8	测试	电学磁学测试	600 (元/时)	360 (元/时)	300	半小时为计量单位
				校内价格是收费标准六折			

附 1 物理所微纳加工实验室收费标准

激光三维直写	1.8	全保刚	1600
电子束光刻(J6300)	1.2	耿广州	2000
聚焦离子束 (DB235/H600i)	1.5	田士兵	2000
DTL光学曝光系统	1.6	全保刚	1600
电子束光刻 (Raith150)	1.1	杨海方	2000
激光直写设备	1.9	杨海方	1600
纳米压印	1.10	金菱子	1600
热蒸发 (2台)	3.1	燕军祥	800
椭圆偏振仪	4.5	张忠山	800
快速退火炉	5.4	张忠山	800
紫外光刻 (MA6)	1.7	全保刚	1600
反应离子刻蚀 (2台)	2.1	耿广州	800
感应耦合等离子体刻蚀 (2台)	2.5	耿广州	1600
离子束刻蚀 (2台)	2.3	全保刚	1000
微波等离子体去胶机 (TEPLA)	2.7	杨海方	800
原子层沉积系统	3.3	耿广州	800
电子束蒸发	3.5	燕军祥	1600
等离子体增强化学气相沉积	3.8	张忠山	1600
台阶仪及白光干涉表面形貌仪	4.8	金菱子	800
超声压焊引线仪 (2台)	5.5	金菱子	800
原子力显微镜	4.2	田士兵	800
四探针物性测试台	4.9	田士兵	1200
纳米压痕仪	4.1	金菱子	800
切片机	5.3	张忠山	300
氦气离子显微镜	1.3	田士兵	2000
临界点干燥仪	5.2	田士兵	2000
台阶仪	4.6	金菱子	800

附 2 北京大学量子材料科学中心微纳加工实验室收费标准与收费办法

仪器名称		校内用户	校外用户	说明	培训费
Helios 600i FIB/SEM 双束显微镜	FIB	1200 元/小时	1600 元/小时		1300 元
	EBL	1000 元/小时	1400 元/小时	自备电子束胶、显影液、定影液；或付费领取。	1100 元
	EDS				1100 元
	SEM				700 元
NXQ4006 紫外光刻机		800 元/小时	1200 元/小时	自备光刻掩模版；光刻胶、涂胶机、热板不另计费。	600 元
LJ-TH400 热蒸发镀膜机		200 元/小时	400 元/小时	以上仅为机时费，材料费另计。	600 元
LJ-E400L 电子束蒸镀系统		300 元/小时	500 元/小时	以上仅为机时费，材料费另计。23:00-8:00 期间下浮 100 元/小时。	600 元
MSP-3200 磁控溅射镀膜机		200 元/小时	400 元/小时	以上仅为机时费，材料费另计。	600 元
ME-3A 反应离子刻蚀机		200 元/小时	400 元/小时		100 元
LKJ-1D-100 离子束刻蚀系统		200 元/小时	400 元/小时		100 元
Dimension Icon 原子力显微镜		300 元/小时	600 元/小时	以上仅为机时费，探针费用另计。	600 元
P-6 表面形貌仪		200 元/小时	400 元/小时		100 元
RTP600xp 快速退火炉		200 元/小时	400 元/小时		100 元

UV-1 紫外线-臭氧清洗机	200 元/小时	400 元/小时		100 元
7476D 引线键合仪	200 元/小时	400 元/小时		100 元
UNITEK 250DP 点焊机	120 元/小时	240 元/小时		100 元
BX51 光学显微镜	100 元/小时	200 元/小时		100 元
UL1000Fab 氦质谱检漏仪	1200 元/天 or 120 元/小时	1600 元/天 or 160 元/小时	可移动式, 如需推至用户实验室使用, 仅限物理学院大楼内。	100 元
MS-20B 皮秒激光加工系统	400 元/小时	800 元/小时		600 元

附 3 清华大学微纳平台仪器收费标准

仪器	使用功能	费用(元/小时) 校内	费用(元/小时) 校外
Sirion SEM	SE(BSE)	200	300
	SE(BSE)+EDS(STEM)	200*机时+100	300*机时+100
	SE(BSE)+EDS+STEM	200*机时+200	300*机时+200
Tecnai TEM	TEM	400	600
	TEM+EDS(STEM)	400*机时+100	600*机时+100
	TEM+EDS+STEM	400*机时+200	600*机时+200
Raman		200/小时 100/点	250/小时 150/点
AFM		200+针费 300	300+针费 300
台阶仪		150	200
喷金		120/次	150/次

	加工内容(设备)	单价(元)		备注
		校内	校外	
键合	热键合 压印	500/小时	1000/小时	
	阳极键合	1200/小时	1800/小时	
电子束曝光	涂胶, 热板, 曝光, 显影	1200/小时	1500/小时	混合套刻标记需清晰, 符合规范
光刻 样品为 Φ100mm 或 Φ50mm	涂胶, 热板, 曝光, 显影台, 显微镜	300/片	400/片	100元开机费 1.0um 线宽, 对准精度单面 0.5-1.0um, 双面 1.0-2.0um。 非 Φ100mm 样品加粘片费 30元/次
	厚胶、双面 SU8 胶	400/片 800/片	500/片 1000/片	
深刻蚀	ICP 刻蚀 Si(Φ100mm), <30um	500/片	650/片	开机费 200 元 >30um, 加收 200 / 10um 校外用户加收 300 / 10um
RIE	RIE 刻蚀 SiO2(Φ100mm)<800nm	200/片	300/片	
	RIE 刻蚀 Si3N4(Φ100mm)<100nm	200/片	300/片	
	RIE 刻蚀 Poly-Si(Φ100mm)<1000nm	200/片	300/片	
	RIE 刻蚀 金属(Φ100mm)	200/片	300/片	
	RIE 去胶(Φ100mm)<1000nm	200/片	300/片	
	IBE	离子束刻蚀	500/片	650/片
溅射	溅射 SiO2<100nm	300/片	400/片	开机费 200 元 非 Φ100mm 样品加粘片费 30元/次
	溅射 Fe<100nm	300/片	400/片	
	溅射 Al<100nm	300/片	400/片	
蒸发 (8片/批)	蒸发 Al<100nm	700/批	900/批	开机费 200 元/批 Au, Pt, Pd 加收 200 / 10nm 校外用户加收 300 / 10nm 非 Φ100mm 样品加粘片费 30元/次
	蒸发 Fe<100nm			
	蒸发 Cr<100nm			
	蒸发 Ti<100nm	1000/批	1300/批	
	蒸发 Ag<100nm			
	蒸发 W<60nm	1800/批	2300/批	
	蒸发 Au<60nm			
	蒸发 Pd<60nm			
蒸发 Pt<60nm				
ALD	Al2O3	400+2.5*cycle	500+3.5*cycle	
CVD	PECVD SiO2 <600nm	600/片	800/片	开机费 200 元
	PECVD Si3N4<300nm	600/片	800/片	
腐蚀	湿法腐蚀 SiO2, 1 2 片 / 批	200/批	300/批	不足 12 片按一批计算
	正胶剥离	200/片	300/片	
腐蚀	湿法腐蚀体硅,	300/100um	400/100um	
清洗	清洗或	200/批	300/批	
	湿法去胶 (≤2um, 1 2 片 / 批)			
退火		200/批	300/批	

附 4 苏州纳米所微纳平台仪器收费标准

2020 年纳米加工平台收费标准

设备名	收费标准及方式 (单位: 元)	备注
Coater ST22+	200 元/小时	光刻胶费用另计
小勺胶台 KF-8A	200 元/小时	光刻胶费用另计
Track KS-L150	200 元/小时	光刻胶费用另计
喷胶机 ST201	400 元/小时	30 分钟为基本时间单元
恒调喷胶机	400 元/小时	30 分钟为基本时间单元
显影机 OPT1sp1in ST22	200 元/小时	30 分钟为基本时间单元
光刻机 M46/B46	800 元/小时	30 分钟为基本时间单元
EVG620 光刻机	600 元/小时	30 分钟为基本时间单元
Stepper NSR125LS2B	1200 元/小时	60 分钟为基本时间单元
Stepper NSR220S112d	1500 元/小时	60 分钟为基本时间单元
Stepper NSR150SC0B	1200 元/小时	60 分钟为基本时间单元
Ultratech Stepper	500 元/小时	30 分钟为基本时间单元
纳米压印 (热压)	400 元/小时	60 分钟为基本时间单元
纳米压印 (紫外)	400 元/小时	60 分钟为基本时间单元
电子束光刻机 IBE-5500Z	800 元/小时	30 分钟为基本时间单元
等离子去胶机 MLL	150 元/小时	15 分钟为基本时间单元
晶片键合机 CRIL	阳极键合、共晶键合, 1 小时以内 500 元/对。超过 1 小时部分, 按照 600 元/小时计算, 以 15 分钟为计费单元, 不包括对准收费。	60 分钟为基本时间单元
双束聚焦离子束 FEI 830	1000 元/小时	60 分钟为基本时间单元
氮气烘箱	80 元/小时	30 分钟为基本时间单元
镀膜组合仪 Spa4000	150 元/小时	30 分钟为基本时间单元
IBE IBE-A-150	400 元/小时	30 分钟为基本时间单元

RIE Top190Se	500 元/小时	30 分钟为基本时间单元
深硅刻蚀 SIS MPX 100K	1000 元/小时	30 分钟为基本时间单元
深硅刻蚀 HSE200S	1200 元/小时	30 分钟为基本时间单元
III-V 刻蚀 ICP 180	700 元/小时	30 分钟为基本时间单元
APEX ICP ICP 380	1000 元/小时	30 分钟为基本时间单元
III-V ICP ICP 380	900 元/小时	30 分钟为基本时间单元
氟化氢气态刻蚀机 memstar	800 元/小时	30 分钟为基本时间单元
光学轮廓仪 NT1100	160 元/小时	15 分钟为基本时间单元
膜厚仪 ST2000-DLX	120 元/小时	15 分钟为基本时间单元
台阶仪 Dektak 150	5 元/分钟	5 分钟为基本时间单元
台阶仪 KLA P17	5 元/分钟	5 分钟为基本时间单元
应力仪	100 元/线	
分光光度计 Lambda 150	100 元/条线	1 条线为基本时间单元, (需要透射或反射附件更换需加收 100 元一次)
四探针测试仪 CRESBOX	120 元/小时	15 分钟为基本时间单元
电子束蒸发 (金属) e1-5u/i-5a-2	大夹具(180 片 2 寸) Au 及合金: 800 元/小时+300 元/次工艺+250 元/层+240 元/10nm; 其它金属(Al, Cr, Ni 等): 800 元/小时+320 元/次工艺+200 元/100nm, 小夹具(12 片 2 寸): 800 元/小时+300 元/次工艺+250 元/层+80 元/10nm; 其它金属(Al, Cr, Ni 等): 800 元/小时+320 元/次工艺+100 元/100nm.	30 分钟为基本时间单元

电子束蒸发 (Cooke)	Au 及合金: 450 元/小时+300 元/次工艺+200 元/层+15 元/nm; 其它金属(Al, Cr, Ni 等): 450 元/小时+300 元/次工艺+1 元/nm	30 分钟为基本时间单元
电子束蒸发 EBE-07	Au 及合金: 500 元/小时+300 元/次工艺+200 元/层+15 元/nm; 其它金属(Al, Cr, Ni 等): 500 元/小时+300 元/次工艺+1 元/nm	30 分钟为基本时间单元
小电子束蒸发 EBE-09	Au 及合金: 280 元/小时+300 元/次工艺+160 元/层+45 元/10nm; 其它金属(Al, Cr, Ni 等): 280 元/小时+320 元/次工艺+60 元/100nm.	30 分钟为基本时间单元
热蒸发 2	250 元/小时+160 元/次工艺+350 元/g (AuSn20) 或 50 元/100nm (In, Sn)	30 分钟为基本时间单元
光学镀膜机 OPTC-900	1000 元/小时+470 元/次工艺	30 分钟为基本时间单元
溅射台 LAB 18	500 元/小时+300 元/次工艺+材料费: 50 元/10nm(Au 及合金、Pd)或 75 元/10nm(Pt) 或 50 元/100nm (其它材料)	30 分钟为基本时间单元
磁控溅射 ULVAC Z-1000	1000 元/小时+300 元/次工艺+材料费: 材料费: 1 元/nm (非贵重金属)	30 分钟为基本时间单元
FHR 溅射台	1000 元/小时+300 元/次工艺+材料费: 30 元/10nm(Au 及合金、Pd 等)或 20 元/100nm (其它材料)	30 分钟为基本时间单元
溅射台 (国产) GC4-2	Au 及合金: 280 元/小时+300 元/次工艺+45 元/10nm; 其它金属(Al, Cr, Ni 等): 280 元/小时+300 元/次工艺+60 元/100nm	30 分钟为基本时间单元
溅射台 DES500	800 元/小时+300 元/次工艺+材料费: 50 元/10nm(Au 等贵金属) 或 50 元/100nm (其它材料)	30 分钟为基本时间单元
PECVD OXFORD 100	900 元/小时	15 分钟为基本时间单元
PECVD 2 / RIE 3 Oxford 80+	500 元/小时	30 分钟为基本时间单元
ULVAC PECVD ULVAC CC-200Cz	1200 元/小时	30 分钟为基本时间单元
NLD 570 刻蚀机	1000 元/小时	30 分钟为基本时间单元
ICP-CVD ICP-CVD 380	900 元/小时	30 分钟为基本时间单元
离子注入机	1600 元/小时	30 分钟为基本时间单元

NV-GSD-HE																		
有机化学气相沉积机 AIX2400 G3	2000 元/小时	60 分钟为基本时间单元																
金属有机化学气相沉积机 CS1711	1000 元/小时	60 分钟为基本时间单元																
G4 MOCVD	1200 元/小时	视实验结构而定, 以一个实验为基本收费单元, 只外延 4 寸片																
Noritake Bake 炉	A 全包 #1 工艺 8100 元一炉 #2 工艺 9600 元一炉 #3 工艺 14700 元一炉 B 共用 小盘 6 个起; 中盘 3 个起: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>#1 工艺</td> <td>#2 工艺</td> <td>#3 工艺</td> </tr> <tr> <td>小盘</td> <td>450 元/个</td> <td>500 元/个</td> <td>817 元/个</td> </tr> <tr> <td>中盘</td> <td>900 元/个</td> <td>1000 元/个</td> <td>1634 元/个</td> </tr> <tr> <td>大盘</td> <td>2700 元/个</td> <td>3000 元/个</td> <td>4900 元/个</td> </tr> </table> 说明: 1. 小盘: 直径<15cm 中盘: 指规格 6x2"/7x2" 或者 直径<23cm 大盘: 指规格 11x4"/13x2"/14x2" 等 2. 全包, 指单次 BAKE 无其他公司的盘 3. 共用, 指单次 BAKE 有其他公司的盘		#1 工艺	#2 工艺	#3 工艺	小盘	450 元/个	500 元/个	817 元/个	中盘	900 元/个	1000 元/个	1634 元/个	大盘	2700 元/个	3000 元/个	4900 元/个	视石晶盘的型号、数量与 BAKE 工艺种类而定, 定价标准只针对 GaN 基 MOCVD 的石晶盘, GaAs, InP MOCVD 的石晶盘需商谈后确定价格。
	#1 工艺	#2 工艺	#3 工艺															
小盘	450 元/个	500 元/个	817 元/个															
中盘	900 元/个	1000 元/个	1634 元/个															
大盘	2700 元/个	3000 元/个	4900 元/个															
LPCVD-CALOGIC LPCVD	900 元/小时	60 分钟为基本时间单元																
抛光机 AP-380F	机时费: 400 元/小时 次氯酸钠抛光液 1 元/毫升 (根据用量收费, 收费条目: 材料费) 氧化钾抛光液 0.5 元/毫升 (根据用量收费, 收费条目: 材料费) 氧化硅抛光液暂不收费 另外: 1 个机时内 (1 小时) 只能更换一次抛光盘	60 分钟为基本时间单元																
研磨机 AL-380F	机时费: 300 元/小时 钻石研磨液: 1 元/毫升 (根据用量收费, 收费条目: 材料费) 研磨盘单独修整 1000 元/次 (收费条目: 其他)	60 分钟为基本时间单元																
减薄机 HRC-150	机时费: 220 元/小时 砂轮更换 200 元/次 (收费条目: 其他) 减薄修整 300 元/次, (根据砂轮修正+砂轮成本计算材料费, 收费条目: 材料费) 另外: 1 个机时内 (1 小时) 只能更换一次砂轮	60 分钟为基本时间单元																
快退火炉 ALLWIN-AR61	500 元/小时	30 分钟为基本时间单元																

	周一至周五，抛光、切割玻璃、陶瓷，15元/刀，周六至周日，抛光、切割玻璃、陶瓷，25元/刀，抛光200元/次	
Disco 划片机 DAD3350(1)	Disco DAD3350(1) 划片收费标准：600元/小时，切割硅片，刀片更换费用300元/次，如需使用刀片，单独计费	30分钟为基本时间单元
Disco 划片机 DAD3350(2)	Disco DAD3350(2) 划片收费标准：600元/小时，刀片宽度为100um，切割玻璃、石英等，刀片更换费用200元/次，如需使用刀片，单独计费	30分钟为基本时间单元
Disco 划片机 DAD601	Disco DAD601 精密切割收费标准：600元/小时，刀片宽度为200um，切割玻璃、石英、陶瓷等，刀片更换费用200元/次，如需使用刀片，单独计费	30分钟为基本时间单元
取片机 90M-90TP	400元/小时	30分钟为基本时间单元
LID 芯片测试仪 8P5-1500	150元/小时	15分钟为基本时间单元
激光解理机 Titan	500元/小时	30分钟为基本时间单元
超声检测 D 8500	240元/小时	30分钟为基本时间单元
X-ray 检测 XTV-165	400元/小时	30分钟为基本时间单元
原子力显微镜 AFM Veeco M5	200元/小时	30分钟为基本时间单元
阻抗力测试 DAGE4000	120元/小时	30分钟为基本时间单元
武漢点胶机 PC350	200元/小时	60分钟为基本时间单元
LIV 解胶机	128元/小时	15分钟为基本时间单元
手动探针台 PW-600	300元/小时	30分钟为基本时间单元
封装贴片机 SECBS0	200元/小时	30分钟为基本时间单元
平行封焊机 SM8500	200元/小时	30分钟为基本时间单元
高低温(湿热)试验箱 ESPEC PC-2J	50元/小时	60分钟为基本时间单元
热重分析 差热分析仪 ESPECT SA-102ES	100元/小时	60分钟为基本时间单元

高加速寿命试验设备 HIRAYAMA PC-422R8	100元/小时	60分钟为基本时间单元
恒加速度试验机 YS34w-3/ZF	200元/小时	30分钟为基本时间单元
电动振动台 DC-600	100元/小时	60分钟为基本时间单元
冲击台 CL-20	100元/小时	60分钟为基本时间单元
高压/高压探针测试系统	800元/小时	60分钟为基本时间单元
充放电测试系统 PL	400元/小时	30分钟为基本时间单元
高分辨X射线衍射仪	300元/小时	15分钟为基本时间单元
PEALD R-200	800元/小时	30分钟为基本时间单元
MARCH 去胶机	240元/小时	15分钟为基本时间单元
翻膜机	不计费	
扩片机	不计费	
ESPEC 高温压机实验箱	30元/小时	30分钟为基本时间单元
8槽硅片清洗机 H-011004	不计费	
甩干机 CSE-SC-0006	不计费	
炉管清洗机	不计费	
Lift-off Wet SB 30	不计费	
先进纳米复合材料创新中心		
纳米拉伸仪	350元/样	
万能材料试验机	200元/样	
复合材料界面测试仪(微滴包埋)	300元/样	
红外辐射仪	100元/样	
分光光度计	200元/样	
气相色谱仪	300元/样(时长1小时,若超过1小时,超时按200元/小时收费)	30分钟为基本时间单元
BET 全自动比表面积及孔隙分析仪	小于8小时, 100元/小时; 大于8小时的部分按50元/小时计	30分钟为基本时间单元
电化学阻抗系统	200元/小时	30分钟为基本时间单元
激光扫描热分析仪	300元/样(时长1小时,若超过1小时,超时部分按200元/小时收费)	30分钟为基本时间单元
热重分析仪	300元/样(时长1小时内,若超过1小时,超时部	30分钟为基本时间单元

快速退火炉 RTP-500	160元/小时; O ₂ 工艺 200元/小时, O ₂ 流量不得大于 2.5L/min	30分钟为基本时间单元
快速退火炉 RTP-150	400元/小时	30分钟为基本时间单元
小管式退火炉 L4508-07-1, L4508-07-2	300元/小时 (氮气), O ₂ 工艺 400元/小时, O ₂ 流量不得大于 2.5L/min	30分钟为基本时间单元
氧化炉-退火炉 HCR8000A	通工艺气体时收费为 600元/小时, 升降温时间为 400元/小时。	60分钟为基本时间单元
管式退火炉 1 L4508 管式炉	100元/小时 (氮气), 200元/小时 (氧气)	30分钟为基本时间单元
氧化炉 1-CALOGIC	600元/小时 (升降温时间 400/小时)	60分钟为基本时间单元
清洗线	240元/小时	30分钟为基本时间单元
基恩士量测仪	5元/分钟	1分钟为基本时间单元
倒装焊机 FC150	1500元/小时	30分钟为基本时间单元
ATV 回流炉 SR0702	220元/小时	30分钟为基本时间单元
引线机 T10702	180元/时	60分钟为基本时间单元
紫外曝光机 ML200 puls	800元/时	60分钟为基本时间单元
手动划片机 598-90TP-1	70元/小时+10元/刀	30分钟为基本时间单元
Loomis 金刚刀解理机 Loomis LS0100	300元/小时	30分钟为基本时间单元
划片机(金刚刀) DPS-402NR	600元/小时	30分钟为基本时间单元
点焊机	300元/小时(两小时起约)	60分钟为基本时间单元
划片机 DBM-412NR	600元/时	30分钟为基本时间单元
扫描电子显微镜 JSM-6300	350元/小时	30分钟为基本时间单元
喷金装置	60元/次	
Disco 划片机	Disco DAD340 收费标准: 600元/小时, 30分钟为基本时间单元 周一至周五, 抛光、切割硅片, 15元/刀, 周六至周日, 抛光、切割玻璃、陶瓷, 25元/刀, 抛光200元/次 Disco DAD 2HVM 收费标准: 400元/小时, 30分钟为基本时间单元	1小时内客户可以自由选择按刀(10刀起)计费或按时间计费

	分按照 200元/小时收费)	
热机械分析仪	500元/样(时长1小时内,若超过1小时,超时部分按照200元/小时收费)	30分钟为基本时间单元
激光导热仪	300元/样/方向, 每加测一个温度点加收200元	30分钟为基本时间单元
动态机械分析仪	400元/样, (时长1小时内,若超过1小时,超时部分按照200元/小时收费)	30分钟为基本时间单元
旋转电液流变分析仪	300元/样 (时长1小时内,若超过1小时,超时部分按照100元/小时收费)	30分钟为基本时间单元
热线法液体导热系数仪	100元/样	
热流法导热仪	200元/样 (时长1小时内,若超过1小时,超时部分按照200元/小时收费)	30分钟为基本时间单元
(傅里叶变换) 显微红外吸收光谱仪	300元/样	
高温试验机	200元/样	
CVD 热处理	100元/小时	30分钟为基本时间单元
高压均质机	200元/小时	30分钟为基本时间单元
热压机	100元/小时	30分钟为基本时间单元
研磨机	200元/小时	30分钟为基本时间单元
矢量网络分析仪	400元/样	
HFM 热流法导热仪	300元/样 (时长1小时内,若超过1小时,超时部分按照300元/小时收费)	30分钟为基本时间单元
接触角测试仪	200元/样 (时长1小时内,若超过1小时,超时部分按照200元/小时收费)	30分钟为基本时间单元
四探针仪	100元/样	
粉末电阻测试仪	100元/样	
高阻微电流测试仪	100元/样	
高温石墨化炉	6000元/次	特殊实验, 只能周日加工测试, 且至少一人在场
激光器室温 P-I-V 测试	100元/样	
激光器变温 P-I-V 测试	500元/样	
无源波导损耗测试	500元/样	
芯片光谱测试	200元/样	
谐振腔反射谱测试	300元/样	
激光器线宽测试	1000元/样	
激光器相位噪声测试	1000元/样	
激光器强度噪声测试	1000元/样	